

仕様 型式 AGPS704-001

〔上部マイクロ스코プ〕				
カメラ	1/3インチCCDカメラ38万画素			
光学倍率	0.8×~5.0×			
W.D. ^{※1}	75mm±1mm			
照明	同軸落射照明			
補助対物レンズ	2.0× 合計倍率：1.6×~10×、WD：24.5mm±2mm			
移動量		可動(粗動調整)	可動(微動調整)	固定ツマミ
	X軸	±40mm ^{※2}	±6.5mm (目量10μm)	1箇所
	Y軸	±50mm ^{※3}	±50mm ^{※3}	2箇所
	Z軸	±50mm ^{※3}	±50mm	2箇所

〔プローピングステージ〕				
移動量		可動(粗動調整)	可動(微動調整)	固定ツマミ
	X軸	—	±12.5mm (目量10μm)	1箇所
	Y軸	—	±12.5mm	1箇所
	Z軸	—	±5mm (目量10μm)	1箇所

〔θ方向回転台〕	
移動量	可動(粗動調整) θ: 360° ^{※4} 可動(微動調整) θ: ±5°

〔ポジションナーテーブル〕				
移動量		可動(粗動調整)	可動(微動調整)	固定ツマミ
	X軸	—	±12.5mm (目量10μm)	1箇所
	Y軸	±64mm ^{※5}	—	1箇所
	Z軸	0~70mm ^{※6}	—	1箇所

〔左右部マイクロ스코プ〕				
カメラ	1/3インチCCDカメラ38万画素			
光学倍率	0.75×~4.5×			
レンズ	テレセントリック系			
W.D.	95.25mm±3mm			
照明	同軸落射照明			
移動量		可動(粗動調整)	可動(微動調整)	固定ツマミ
	X軸	—	±6.5mm (目量10μm)	1箇所

〔ライトガイド〕	
ライトガイド	3分岐
光源	ハロゲンランプ 12V 100W

〔測定試料最大寸法〕	
サイズ	80mm(幅) × 80mm(奥行き) × 50mm(高さ)

〔その他構成品〕	
4端子法DC測定針	ダングステンニードル
アクティブ差動 プローブシステム用 プローブ針とプローブアンプ	アジレント・テクノロジー社製 ^{※7} プローブ針(N5382)、プローブアンプ(1169A)
PNA-L ネットワーク・アナライザ	(例) アジレント・テクノロジー社製 300kHz~50GHz、4 port、機能詳細問い合わせ
デジタルマルチメーター	(例) アジレント・テクノロジー社製 7桁、高速サンプリング、機能詳細問い合わせ
その他	機能詳細問い合わせ

〔本体寸法と重量〕	
寸法	600mm(幅) × 400mm(奥行き) × 681mm(高さ)
重量	36kg

標準構成



DC測定用と高周波測定用の
2タイプが取付可能。
マイクロポジションナー



レールポジションナー



側部カメラ
CCDカメラ



上部カメラ
CCDカメラ



別置き真空ポンプ&真空ベン



CAM View

オプション

アジレント・テクノロジー社製の全てのネットワーク・アナライザと組み合わせることができます。
ネットワーク・アナライザに関する詳しい情報は、弊社までお問い合わせ下さい。

ネットワーク・アナライザ  ^{※7}



校正基板



|Z|Probe
GSG~40GHz、~50GHz
ピッチ 50um~1250um



Dual |Z|Probe
GSSG(デュアル) ~10GHz
ピッチ100um~500um

高周波プローブ |Z|Probe ^{※8}



アクティブプローブホルダー



防振台(卓上タイプ)



防振台(デスクタイプ)

※1 W.D.とはレンズ端面から被測定物までの距離です。
 ※2 最小移動量: 2.5mm
 ※3 ハンドル1回転の移動量 粗動: 18mm、微動: 2.3mm、最小読み取り: パーニア目盛り0.1mm
 ※4 最小読み取り: パーニア目盛り0.1°
 ※5 ハンドル1回転の移動量: 24mm
 ※6 ハンドル1回転の移動量: 3mm

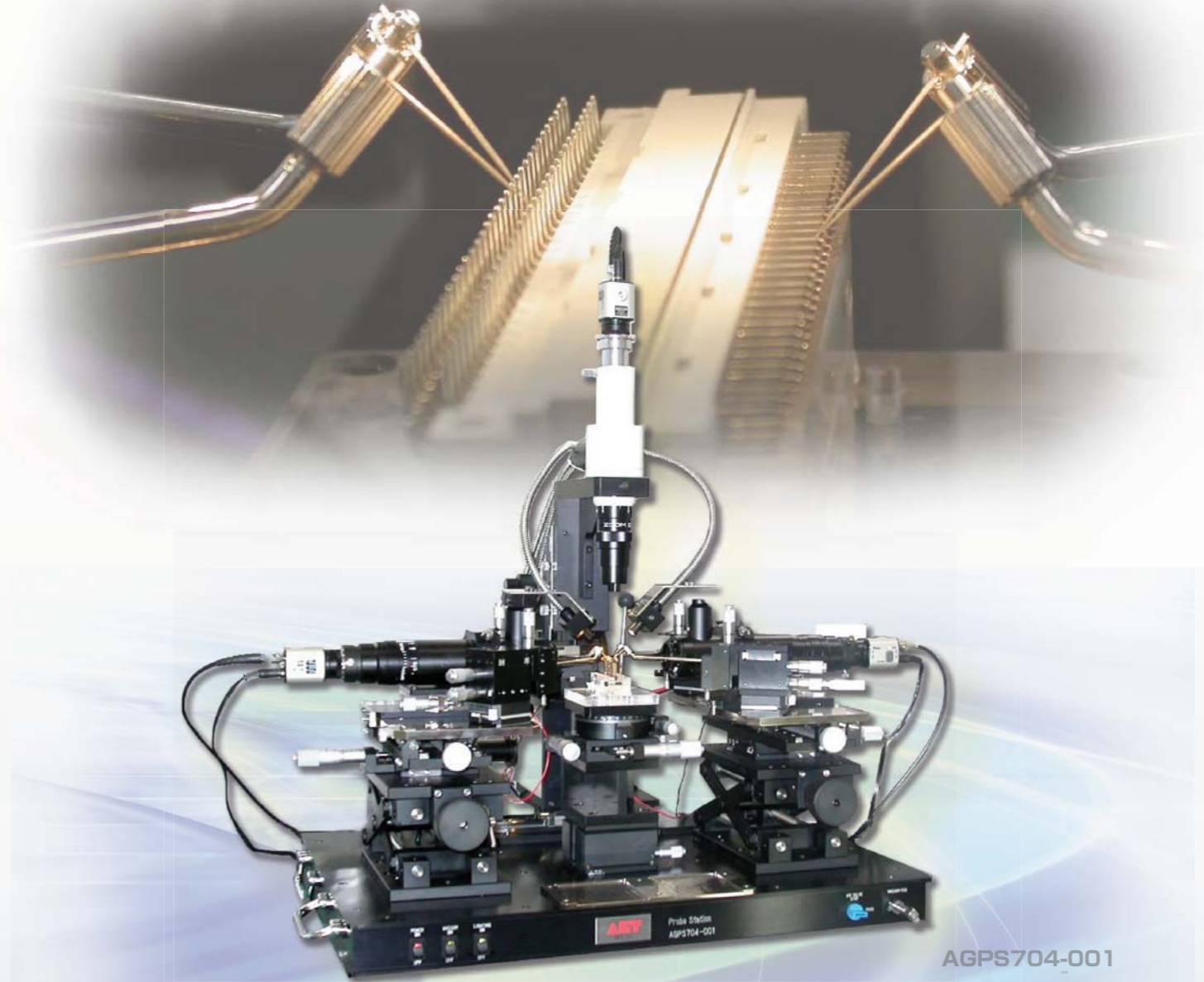
※7 弊社はアジレント・テクノロジー社とソリューションパートナー契約を締結しています。
 ※8 |Z|Probe は、カスケード・マイクロテック社の製品です。
 株式会社エイイーティーはカスケード・マイクロテック株式会社のビジネスパートナーです。

- 本製品の仕様及び外観は、改良のため、予告なく変更する場合があります。ご発注の際には営業窓口にご確認ください。
- 本製品仕様書を断りなく複写することは禁じます。

©2011 AET Inc, All rights reserved. C111026-HA108-004



プローブステーション 三次元

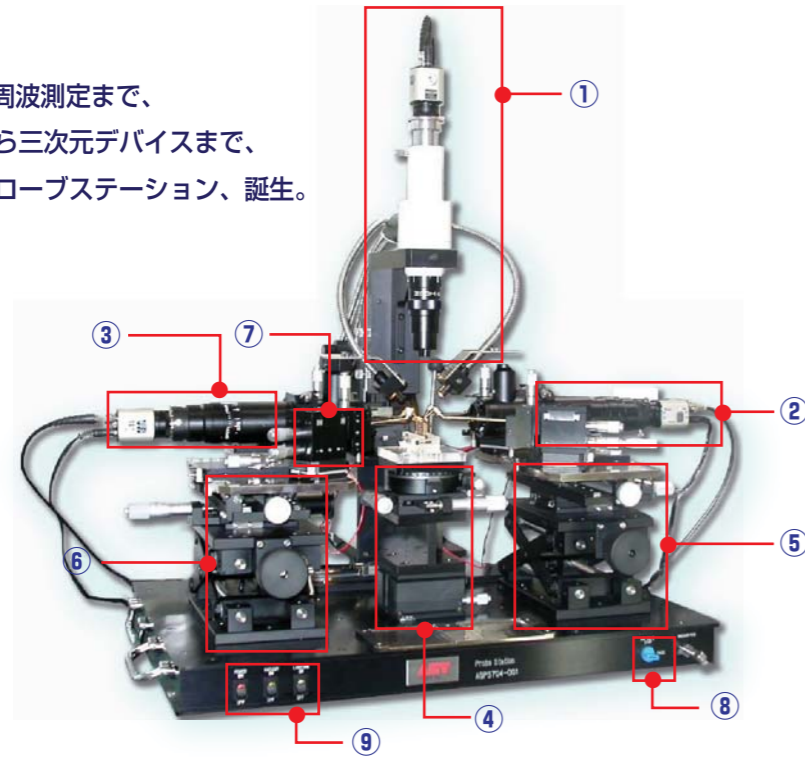


測定資料サイズ 80mm×80mm×50mm の立体的な形状面にダイレクトにプローピングできます。

X,Y,Z,θ 軸全てに粗動、微動ステージが搭載され、フレキシブルなプローピングが可能です。

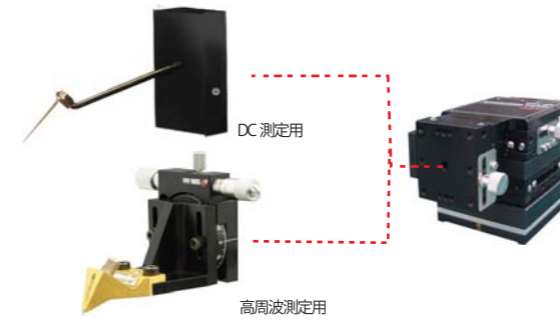
IC ソケット、コンタクトピン、高周波モジュール、基板表裏測定に有効です。

DC 測定から高周波測定まで、
平面デバイスから三次元デバイスまで、
自在に使えるプローブステーション、誕生。



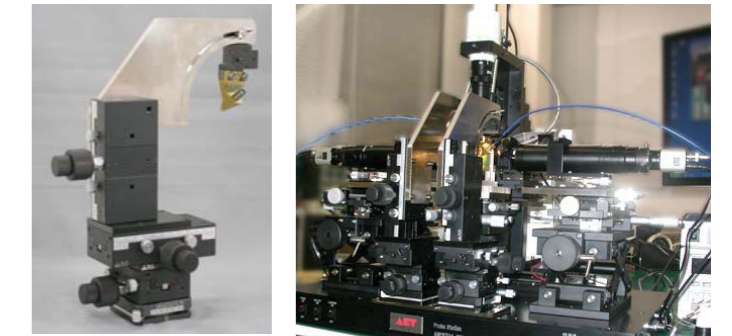
- ①ズームマイクロ스코フ (上部)
- ②ズームマイクロ스코フ (右)
- ③ズームマイクロ스코フ (左)
- ④プロービングステージ
- ⑤ポジショナーテーブル (右)
- ⑥ポジショナーテーブル (左)
- ⑦マイクロポジショナー
- ⑧エアバルブセレクトスイッチ
- ⑨電源・ライト・真空ポンプスイッチ

マイクロポジショナー & レールポジショナー



■ マイクロポジショナー

X-Y-Z軸の3方向からの位置決めプラスして、前面の θ 軸が回転することにより高精度な位置決めを保証します。前後、左右および上下方向の位置決めは、X-Y-Z 軸のマイクロメータで微調節します。



■ レールポジショナー

プローブをレールに沿って移動させるとプローブの向きを90度まで変更可能。プローブ上部の θ 軸調節ネジを回すと、プローブ針先をあまり角 $\pm 3^\circ$ の範囲で傾けることができます。プローブの向きを基板面に平行に合わせることができます。プローブの向きを水平および垂直方向に簡単に移動できるので、基板やプローブの向きを調整する手間が省けます。

ズームマイクロSCOPE

ズームマイクロSCOPEは、同軸落射照明付きの高倍率ズームレンズと CCD カメラを組み合わせたもので、本プローブステーションには3台搭載されています。

■ 上部マイクロSCOPE (1台) の位置合わせ

- X方向の移動は後部レバーで粗動調節
マイクロメータで微動調節
- Y-Z方向の移動は粗動・微動ツマミで調節

■ 左右マイクロSCOPE (2台) の位置合わせ

- X方向の移動はマイクロメータで微動調節
- ズームマイクロSCOPEが不要時は取り外し可能



上部に搭載された
CCD カメラ



左右に搭載された CCD カメラ

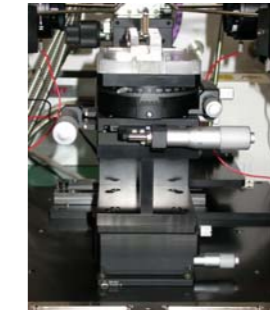
プロービングステージ & ポジショナーテーブル

■ プロービングステージ

プロービングステージには、X-Y-Z 軸マイクロメーター微動調整ツマミと、 θ 軸方向に移動できる回転台を装備しています。位置決めを行った後、X 軸方向に平行移動させると基板のライン上を、また Y 軸方向に平行移動させるとラインのピッチ間をスムーズに移動でき、連続測定が容易になります。ワークプレート上の測定物は、真空ポンプで吸着されており、安定した測定が可能です。

■ ポジショナーテーブル

X-Y-Z 軸の調整ツマミを装備。Y 軸、Z 軸はロック固定することができます。



プロービングステージ



ポジショナーテーブル

Application プロービングバリエーション

応用 : IC パッケージ、IC ソケット、インターコネクタ、コンタクトピン、高周波モジュール、プリント配線基板、IC チップ

	平面プロービング	差動伝送路基板	垂直ピン(左) + 水平ピン(右)	多極コネクタ	垂直ピン(左) + 垂直ピン(右)	IC ソケット	表裏プロービング	両面プリント基板
DC 測定	平面測定	上面	コネクタ勘合	上面 / 左側面 / 右側面	端子を両側から測定	上面 / 左側面 / 右側面	表面と裏面から測定	上面 / 表面 / 裏面
高周波測定	平面測定	上面	IC ソケットピンの測定	上面	基板パターンの表裏測定	表面 / 裏面	ピンの高周波特性を測定	上面 / 表面 / 裏面